

## 【S-05】

### 저 에너지 이온빔으로 표면처리된 PVDF의 표면특성과 접착특성

이철수, 백영환\*, 한성\*, 주진수, 고석근\*

고려대학교 물리학과, \*(주) P&I

Poly(vinylidenefluoride) (PVDF) 필름을 Ion Assisted Reaction (IAR)으로 표면처리 하였다. 일정한 산소의 분압에서 1 keV 의 아르곤 이온을 시료의 표면에 조사하였다. 표면처리 되지 않은 PVDF의 표면에너지는 36 erg/cm<sup>2</sup> 이었고, IAR로 표면처리 된 PVDF의 표면에너지는 64 erg/cm<sup>2</sup> 까지 증가하였다. 표면처리하지 않은 시료의 Rms 표면거칠기는 88 Å 이었고, 표면처리 된 시료는 55.8 Å에서 106 Å 이었다. IAR로 인한 PVDF 표면에 화학적 결합상태의 변화를 확인하기 위해 XPS 실험을 수행하였고, 산소를 포함하는 친수성 작용기 들이 시료의 표면에 형성되었음을 확인하였다. 표면처리하지 않은 시료와 표면처리한 PVDF 필름을 이용하여 고분자 및 금속과의 접착 실험을 통해 크게 향상된 접착 강도를 확인하였다.